**Mikroskop metalograficzny do obserwacji w jasnym i ciemnym polu w świetle odbitym z kamerą mikroskopową wraz z zestawem do polaryzacji do wygaszenia refleksów oraz oprogramowaniem do składania zdjęć w osi Z.**

Parametry mikroskopu - mikroskop metalograficzny:

• nasadka obserwacyjna Siedentopf (lub równoważna), obrotowa 360°, z regulacją rozstawu międzyźrenicowego 48-75 mm,

• port do podłączenia kamery ze stałym podziałem wiązki światła (okulary : fototubus) 50:50%,

• tubusy okularowe nachylone pod kątem 25,

• okulary szerokopolowe UCWF10X/22 (lub równoważne) z regulacją dioptrii ±4D,

• oświetlacz episkopowy LED 3W do prowadzenia obserwacji w polu jasnym BF, ciemnym DF oraz ciemnym segmentowym DF ze szczelinami na polaryzator / analizator oraz filtry,

• rewolwer 5 -gniazdowy, kodowany (Motic LightTracer lub równoważny),

• obiektywy BF/DF planachromatyczne 5X/0.13, 10X/0.25, 20X/0.40

• wysokoaperturowy plan semi-apochromat 50X/0.80,

• stolik przedmiotowy 300x180 mm, przesuwny min 100x100 mm, max 200x100mm (6x4-cale),

• współosiowe ogniskowanie zgrubne i precyzyjne (skok 2 um) w zakresie min 20 max 30 mm, ze sprzęgłem regulacji makro,

• port USB do zasilania kamer cyfrowych,

• przewód zasilający długość min 0,5 m.

• pokrowiec antystatyczny,

• klucz regulacyjny

Parametry kamery mikroskopowej - kamera mikroskopowa wysokiej

czułości:

• matryca sCMOS 2/3", rozdzielczość 5.0 MPix (2448 x 2048 pix), rozmiar piksla 3.45 x 3.45 um,

• szybkość odświeżania przy maks. rozdzielczości 37.5 fps,

• czas ekspozycji 14 us do 2 s, czułość 1146 mV (G) przy migawce 1/30 s,

• złącze USB 3.1,

• wzorzec kalibracyjny wraz z oprogramowaniem bazowym w jęz. Polskim

• adapter z faktorem 0.65x do podłączenia kamery cyfrowej

• (2/3") ze złączem C-mount do mikroskopów.

Parametry zestawu do polaryzacji:

• analizator obrotowy do oświetlaczy episkopowych mikroskopów

• polaryzator do oświetlaczy episkopowych mikroskopów

Parametry oprogramowania do składania zdjęć w osi Z:

• program do akwizycji i archiwizacji danych podczas pracy z mikroskopami, zawierający funkcje pomiarowe i zautomatyzowane pobierania i syntezy obrazu w osiach x,y,z